

# 脱保護反応解析装置シリーズ

## PAGA-100/PAGA-100EUV

### LINEUP

#### PAGA-100

#### 脱保護反応解析装置



##### 特徴

In-situの露光後ベーク・モニタリング機構を有する、FT-IRスペクトロメータをベースとした化学増幅型レジスト用脱保護反応、架橋反応解析装置です。FT-IR室内にベークプレートを配置し、加熱しながら官能基の変化を観察できます。また、紫外線(248nm)照射装置も搭載されており、露光中における酸発生のメカニズムなどの解析にも利用できます。

FT-IRシステム: FTS-3000、検出器: MCT対応 (バリアンテクノロジー社製)

ベークユニット: 4~8インチ対応 (Max150℃)

露光ユニット: 超高圧水銀UVランプ(波長選択可 436,365,248nm)

#### PAGA-100EUV

#### EUVリソ対応脱保護反応解析装置



##### 特徴

PAGA-100の姉妹機。PAGA-100ではレジスト膜厚200nmが限界。そこで、光路がレジスト膜を斜めに通るように設計し、レジスト膜厚75nmでの測定を可能にしました。EUVリソのような超薄膜レジストプロセスの解析に最適です。

リソテックジャパンでは、常時ご評価頂くためのデモ装置を準備しております。ご来訪の上、評価頂くか、サンプルを送付して頂ければ、各装置評価用のデータ取得を行いますので、お気軽にお申し付けください。また、特殊な仕様についても検討いたしますのでご相談ください。

**LTJ** リソテックジャパン株式会社  
Litho Tech Japan

〒332-0034 埼玉県川口市並木2-6-201  
TEL 048-258-6775 FAX 048-258-6673  
E-mail: tech-support@ltj.co.jp  
<http://www.ltj.co.jp>

リソテックジャパンはリソグラフィの未来を見つめ続けています